# 科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

## 平成 24 年 6 月 13 日現在

機関番号:14401
研究種目:研究活動スタート支援
研究期間:2010~2011
課題番号:22860034
研究課題名(和文)
微小球共振器を用いた3次元微細形状計測用マイクロプローブに関する研究
研究課題名(英文)
Microsphere resonator based micro-probe for 3-dimensional coordinate metrology
研究代表者
道畑 正岐(MICHIHATA MASAKI)
大阪大学・大学院工学研究科・助教
研究者番号:70588855

研究成果の概要(和文):部品サイズが数 mm 以下の構造物形状を計測評価可能な超高精度座 標測定器(CMM)のための表面検出プローブの開発が急務である。本研究では、微小球共振 (WGM)を用いた新原理を提案している。プローブ開発の基礎的研究として、プリズムもし くはテーパファイバを用いて WGM を発生させる装置の構築を行った。また、WGM プローブ による表面検出の分解能を検証するための装置の構築を行った。

研究成果の概要(英文): In order to measure the objective in size below a few millimeters, the nanocoordinate measuring machine (CMM) is highly required. Since the surface sensing probe is a key device for the nano-CMM, we proposed a new probe principle based on the whispering gallery mode (WGM) resonance. For the fundamental experiments, the equipments to generate WGMs with either a prism surface of a tapered optical fiber were developed. Beside, the equipment to evaluate the surface sensing resolution of the WGM probe was developed.

### 交付決定額

(金額単位:円)

			(並領半位・口)
	直接経費	間接経費	合 計
2010 年度	1, 260, 000	378, 000	1, 638, 000
2011 年度	1, 160, 000	348,000	1, 508, 000
年度			
年度			
年度			
総計	2, 420, 000	726,000	3, 146, 000

研究分野:計測工学

科研費の分科・細目:生産工学・加工学 キーワード:微小球共振、NSOM、マイクロプローブ、光カップリング

#### 1. 研究開始当初の背景

マイクロ加工技術によって、部品サイズが 数 mm 以下の構造物の製造が実現されている。 しかし、それらの計測評価技術の整備は十分 でない。そこで、3 次元形状を評価可能な超 高精度座標測定器(CMM)の開発が急務であ る。これまでに開発された超高精度 CMM の 測定不確かさは 100nm 程度に達するが、マイ クロ部品の測定評価には測定不確かさ 50nm 以下が求められる。その改善の要となるのが、 測定物表面位置を検出するプローブシステ ムである。

2. 研究の目的

そこで本研究は超高精度 CMM マイクロプ ローブシステムを目指すものである。本プロ ーブシステムの基本構成は、光ファイバ (φ3μm)の先端に直径 5μm のシリカ球を接 続したものである。光ファイバに入射した光 が伝播し、端面の開口でエバネッセント光を 発生させる。エバネッセント光がプローブ球 に入射する。ここで、プローブ球が微小球共 振器として働き、球の内部でWhispering gallery mode (WGM) 共振が生じる。プローブ 球内部で光は全反射を繰返すため、プローブ 球の表面には3次元全方向にエバネッセント 光が局在する。エバネッセント光の有効範囲 は波長程度であるため、プローブ球が測定面 の極近傍に接近すると、局在エバネッセント 光が散乱し、球内の光エネルギが解放される。 この時の光エネルギの損失を、光ファイバの 戻り光強度で観測することによって、表面の 位置を検出する。

これらの原理を用いたプローブシステム を構築するために、まず、WGM を球内に発 生させるシステムおよびそれを検出するシ ステムの構築を行うことを本研究の目的と した。

### 3. 研究の方法

本研究では、始めに、微小球共振器へ光を 入射させ、球内部でWhispering Gallery Mode(WGM)という光伝搬を起こす必要があ る。また、そのWGMが発生した微小球に発 生している近接場によって、どの程度の分解 能で表面が検出可能であるかを検証する。

その基本的な原理の検証として、本研究で はまず、従来の方法でWGMを発生させる。 ①プリズム表面で発生する近接場を用いて 微小球内でWGMを発生させる。しかし、そ の方法では高い効率が得られなかったため、 ②テーパファイバを用いて微小球内にWGM を発生させる装置の開発を行った。次に、③ WGMを発生させた微小球の表面近傍に物体 が接近した時の散乱光の状態等を検証する ための、基本的な装置を校正した。

4. 研究成果

WGM を発生させるため、以下の様な装置 を構築した(図1,2)。

光源には半導体レーザを用いて、励起電流 の調整により発振波長を変化させる。プリズ ム表面に45°入射し、表面で全反射をおこす ことで、プリズム表面でエバネッセント光を 発生させた。その表面に、別のステージに固 定された微小球(ガラス棒先端を溶融して作 製した球)を接近させ、球内部に光をカップ リングする。その時の様子をプリズムの反射 光を分光計で測定し、CCDを用いた上面観察 系により観察する。実験装置の概要を図1に、 写真を図2に示す。実験に用いたガラス球の 顕微鏡写真を図3に示す。今回は約30μm 程 度の直径のガラス球を用いた。

次に、図4にそのガラス球で発生させた WGMの観測の様子を示す。横軸は入射項の 状態を分光計で測定した波長、縦軸は各波長 に対して、CCDで測定した球表面で散乱する



図 1: On-prism の WGM 発生装置概要



図 2: On-prism の WGM 発生装置



図3:用いたガラス球



光量である。635.6nm 辺りで光量が大きくなっていることがわかり、WGM の発生が確認 出来る。また、この波長を用いて球の直径を 見積もると34.1μm 程度であった。しかし、 その SN 比は低く、分光計の分解能も十分で はなかった。

そこで、WGM の効率的な発生を行うため、 テーパファイバを用いたガラス球への光入 射を行った。装置の概要を図5に示し、入射 の CCD 画像を図6に示す。



図5: テーパファイバ WGM 発生装置概要



図 6 : 光入射の様子

本実験では、光源には波長可変レーザを用 いた。1500±25nmで波長を変更でき、その 分解能は20pmである。その光源をテーパフ ァイバに入射し、そのテーパファイバ表面で 発生させるエバネッセント光によって、微小 球へ光を結合する。その時の様子を図6に示 す。テーパファイバへの入射光量を*I*,とし、 テーパファイバのもう一つの端面から射出 される光量を*I*,とする。*I*,に対して*I*,が低い 場合、光は微小球内に結合され、WGMが効 率的に発生する。しかし、本実験では、現状 10%以下の効率しか得られておらず、原理の 更なる理解と装置の改善が必要である。

一方で、この WGM によって微小球表面に 発生させた近接場光によってどの程度の位 置検出分解能が得られるのかを測定するた めの装置を構築した。

図1で構築した近接場光の発生装置を代用 し、そこに先端を500nmに先鋭化されたタン グステンプローブでエバネッセント光を散 乱させ、光電子増倍管での受光時にロックイ ン検出を導入することで、近接場光を高感度 に検出する。その装置図の概要を図7に、写 真を図8に示す。





図8:近接場検出装置写真



図9に本装置を用いてプリズム表面に発生させた近接場の検出を行った結果を示す。横軸 はタングステン針の移動量で、右に行くほど プリズム表面に接近している。その時に散乱 光量が縦軸である。図に示すようにタングス テン針がプリズムの表面近傍では高い散乱 光が観測されており、近接場光を高分解能に 検出可能であった。今後は、本装置を用いて WGM プローブの分解能を評価することを予 定している。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計2件)

- 市川雄一,林照剛,高谷裕浩,<u>道畑正岐</u>: "WGM 共振を用いたマイクロ粒子における真球度評価の基礎的研究",2010 年度日本機械学会関西学生会卒業研究発表講演会,2011 年 3 月 18 日,京都工芸繊維大学
  峨家諒介,林照剛,高谷裕浩,道畑正岐:
- 2 戦後は57, 松原町, 同石裕宿, <u>三川二岐</u>. "微小球共振器を用いた位置検出マイクロ プローブのための基礎的研究", 2010 年度 日本機械学会関西学生会卒業研究発表講 演会, 2011 年 3 月 18 日, 京都工芸繊維大 学

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕○出願状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: ○取得状況(計◇件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別: [その他] ホームページ等 6. 研究組織 (1)研究代表者 道畑 正岐 (MICHIHATA MASAKI) 大阪大学・大学院工学研究科・助教 研究者番号:70588855